INTERNATIONAL STANDARD

ISO 23170

First edition
2022-06

Surface chemical analysis — Depth profiling — Non-destructive depth profiling of nanoscale heavy metal oxide thin films on Si substrates with medium energy ion scattering

Analyse chimique des surfaces — Profilage d'épaisseur — Profilage d'épaisseur non destructif de films minces d'oxydes de métaux lourds à l'échelle nanométrique sur des substrats de Si par diffusion d'ions de moyenne énergie

Reference number
ISO 23170:2022(E)

© ISO 2022

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn